秋田県立大学 機械工学科 教授 鈴木 庸久 (2020 年度 一般研究開発助成 AF-2020233-B3)

キーワード:レーザ誘起プレーティング,ナノカーボン,金属析出,金属3Dプリンティング

1. 研究の目的と背景

レーザ誘起プレーティング¹¹は, めっき液中に浸漬させ た基板にレーザを照射することで, 局所的に金属を析出さ せる技術である.マイクロサイズの金属析出物の造形が可 能であるため, 3D-MID や高精細な金属 3D プリンターな どへの応用が期待されている.

我々は、無電解ニッケル(Ni)めっき液中の鉄基板に対 して、連続波レーザを用いたレーザ誘起プレーティングを 行い、レーザ照射時間、レーザ出力に対するNi析出物の 性状の変化、基板表面の温度分布および温度変化とNi析 出形態との関係、析出温度条件を明らかにした²⁾.しかし、 Niの析出速度の制御、基板温度分布から生じるNi析出物 の膜厚の不均一などが課題となっている.これらの課題を 解決するための1つの方法は、めっき液中に、添加物を混 合し、レーザの吸収、散乱を生じさせることが考えられる. 本報告では、レーザ光の基板への吸収率とめっき液中での 吸収率を制御するために、めっき液中にカーボンブラック (CB)を添加し、CBの添加量とNi析出物の性状から、 レーザ誘起プレーティングによるNi析出機構へのCB添 加効果を考察する.

2. 実験方法

2.1 レーザ誘起プレーティングの実験装置

Fig. 1 に、レーザ誘起プレーティングの実験装置の構成を示す. Table 1 に、レーザ誘起プレーティングの実験 条件を示す. 波長 980 nm の連続発振マルチモードファ イバレーザを用い、コリメータレンズとコンデンサレン ズで集光したレーザ光を、石英ウィンドウを介し、めっき 液に浸漬させた厚さ 0.3 mm の鉄基板に 300 s 照射した. 中高リンタイプの無電解 Ni-P 液 (メルテックス製メルプ レート Ni-2280LF) を 24 ℃に保温し、ポンプを用いて 流量 0.3 L/min で循環させ、石英ウィンドウ端面と鉄基 板の間をめっき液の流液で満たした. Ni-P 析出実験では、



Fig. 1 Schematic illustration of experimental equipment for laser enhanced electroless plating.

レーザ出力を 20 W とした.レーザ照射時のスポットサイ ズが最小となる光路長を測定し,大気との石英ガラスおよ びめっき液の屈折率差を考慮して焦点距離(デフォーカス 量 0 mm)を求めた.デフォーカス量は,光路長が長くな る方向を正とした.Ni-P 析出物の観察および表面元素分

Table.1	Experimental	conditions	of	laser	enhanced
electrole	ss plating				

Laser wavelength [nm]	980		
Time [s]	300		
Power [W]	10, 20		
Defocus length [mm]	-1.5 - 1.5		
Plating solution	Ni-P (P wt% : 8–11)		
Bath temperature [°C]	24		

Table. 2 Amount of CB and gap	length on Laser-Enhanced	Electroless plating
-------------------------------	--------------------------	---------------------

Sample	Laser [W]	Gap length [mm]	CB[g/L]
CB00G3		2	0
CB10G3	20	5	1.0
CB00G1			0
CB01G1		1	0.1
CB10G1			1.0



Fig. 2 Schematic illustration of experimental equipment for laser enhanced electroless plating with CB particles.

析は、走査型電子顕微鏡 (SEM) により行い、断面プロフ ァイルは、レーザ顕微鏡で計測した.

2.2 基板裏面温度および表面輝度分布の測定

レーザーを照射し、Ni を析出させる鉄基板は、基板裏 面温度の測定のために、裏面に厚さ約3.5 μmの黒色のア クリル塗膜を形成し、単結晶ゲルマニウムウィンドウ(厚 さ2mm)の上に固定した.サーマル顕微鏡(Apiste 製 FSV-2000, 波長域:8-14 µm)を用いて, 前記ゲルマニ ウムウィンドウから、レーザ照射時の基板裏面の温度分布 を測定した.温度測定では、流液をイオン交換水とし、レ ーザ出力を 10 W とした.

コリメータレンズとコンデンサレンズの間に偏光ビー ムスプリッタ (PBS) を設置し、大気中で感光紙へのレー ザ照射時の表面輝度分布を,可変型減光フィルター

(THORLABS 製 NDC-50C-4M-B, 減光率 99.82%) を 介し,赤外線カメラ(ARTRAY 製ARTCAM-130HP-WOM) で撮影した.輝度分布の測定では、レーザ出力を 3.8 W と した.

2.3 カーボンブラック(CB)添加レーザ誘起プレーテ ィングの実験

Table 2 に、カーボンブラック添加レーザ誘起プレーテ ィングの実験条件を示す. Fig.2 に実験装置の構成を示す. 波長 980 nm の連続発振マルチモードファイバレーザを 用い, レーザ出力 20 W のレーザ光を, 石英ウィンドウを 介し、めっき液に浸漬させた厚さ 0.3 mm の鉄基板に 60 s照射した.カーボンブラック分散液(大成化工製 TWBK-416F, CB 径約 177 nm) を 0 - 1.0 g/L 添加した中高リ ンタイプの無電解 Ni-P 液(メルテックス製メルプレート Ni-2280LF)を24 ℃に保温し、ポンプを用いて流量0.3 L/min で循環させ、石英ウィンドウ端面(厚さ2mm)と 鉄基板の間(レーザ伝搬長1mmもしくは3mm)をめっ き液の流液で満たした.

3. 実験結果および考察

3.1 レーザースポットのエネルギー分布の影響

デフォーカス量による基板裏面最高温度は,基板裏面温 度は、焦点距離付近(デフォーカス量0.3mm)で最大と なり, デフォーカス量により低下する. これは, デフォー カスにより、エネルギー密度が低下したためであると考え られる.

Fig.3に、レーザ照射部の輝度分布を示す. 焦点距離で スポット径が約0.8mmとなり、輝度はデフォーカス時よ りも高い. 負のデフォーカス距離でスポット径が大きくな り、正のデフォーカス距離では、輝度が低下し、検出でき るスポット径が小さくなった.

Fig. 4, Fig. 5 に, それぞれ Ni-P 析出物の SEM 像およ び Ni-Kα像を示す. スポット中心の直径約 200 μm の範 囲に Ni 析出物, その周辺の直径約1 mm 範囲に薄い Ni







(b) 0 mm Fig. 5 Ni-Kα images of Ni deposits generated by laser enhanced electroless plating.

被膜が見られた. 各デフォーカス量における Ni-P 析出物 の断面プロファイルを測定したところ, デフォーカス距離 -1.2 mm では, ほぼ平坦な Ni 被膜がみられた. 焦点距離 では,中心部に平均的に厚みがあり,結晶成長を伴ったと 考えられる Ni-P 析出物が形成された. 正のデフォーカス させた状態では,中央が凹み,クレーター形状となった. このように, CB を添加しないめっき液を用いた場合には, レーザスポットのエネルギー分布が反映した Ni 析出形態 になることがわかった.

3.2 カーボンブラック(CB)添加の影響

Fig. 6 に, CB 添加量とギャップ長による基板裏面の最高温度の時間変化を示す. CB 添加量の増加に伴い最高温度は低下する. めっき液中のレーザ伝搬長を規定するギャップ長 1mm と 3mm を比較すると, 3 mm の最高温度が低い. これは, めっき液に添加した CB がレーザ光を吸収することで, 基板に当たるエネルギーが低下したためであると考えられる. CB 0 g/L では, レーザ照射直後が最も基板温度が高くなる. 一方, CB 添加量が多くなると, レーザ照射後にゆっくりと基板温度が増加し, 一定になる. これは Ni 析出物内に CB が取り込まれ, 基板のレーザの吸収率が上がったためと考えられる.

Fig. 7 に,各 CB 添加量における基板裏面の温度分布を示す. CB 0 g/L では、レーザ照射直後から温度分布はほぼ変わらないが、CB 添加量が増すにつれて、温度分布が一定になるまでに時間がかかることがわかる.

Fig.8 に、各CB添加量における断面プロファイルとEDS



Fig. 6 Max temperature of substrates backside by laser irradiation

の Ni-K α 線分析結果を示す. CB 添加量 0, 0.1 g/L では 針状の析出物が, 1.0 g/L では表面粗さは悪いものの, 平 坦な形状の Ni 析出物が見られた. Ni は, 主に凸部に存在 した.

Fig. 9 に, CB 添加量に対する Ni 析出物の組成の変化 および直径の変化を示す. CB 添加量の増加に伴い, C, Fe は増加し, Ni は低下する. 一方, Ni 析出物の直径は増 加する. 以上より, CB の添加により, 基板へのレーザ吸 収率が減少し, 基板温度が低下することから, Ni 析出速 度が低下し, めっき液中の CB によりレーザが散乱し, レ ーザ照射部が広がり, 温度分布が緩やかになり, 比較的平 坦な Ni 析出物が形成されたと考えられる.



Fig. 7 CB amount dependence of backside temperature distribution of Fe substrates



Fig. 8 Ni distribution and height of Ni deposits



Fig. 9 Chemical composition and diameter of Ni deposits

4. 結言

無電解 Ni-P めっき液中に設置した Fe 基板へ連続波レ ーザを用いてレーザ誘起プレーティングを行い,デフォー カス量に対する Ni 析出物の性状,基板温度,スポット部 の輝度分布を評価したところ,以下のことがわかった. レーザ照射部の中央に,直径約 200 µmの Ni-P 析出 物が成長し、その周辺部に直径約1mm範囲に薄いNi-P 被膜が形成される.正のデフォーカス範囲において、Ni-P析出物の平均高さは増加するが、デフォーカス量が大き くなるとNi-P析出物の中央部に凹みが形成される.Ni-P 薄膜の直径は、デフォーカスに伴うスポット径の変化と相 関が見られる.

さらに、連続波レーザを用いたレーザ誘起プレーティン グにおいて、めっき液中へ CB を添加すると、基板温度が 低下し、温度分布が一定になるまでに時間がかかる.その 結果、Ni 析出物の析出速度は遅くなるが、CB を含んだ比 較的膜厚が均一な Ni 析出物を得ることができることが明 らかになった.

参考文献

- Noboru Morita et al., Journal of the Japan Society for Precision Engineering, Vol. 57 (1991) 2199-2205
- 上野 翔太郎 他,有限要素法による連続派レーザを用いたレーザ誘起プレーティングにおける基盤温度分布の解析,表面技術協会第 146 回講演大会,06C-22,(2022.9)